

公開番号／特許登録番号 特許5558869

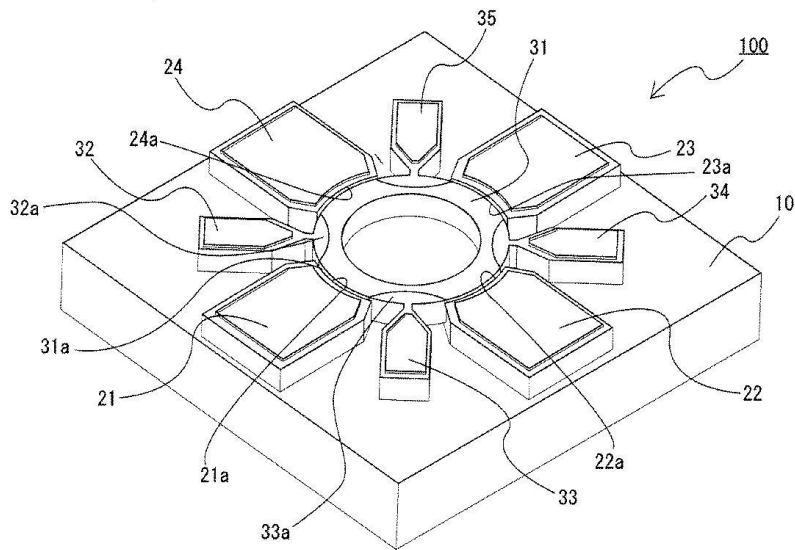
発明の名称 MEMS

出願人または特許権者 オムロン株式会社
国立大学法人 東京大学

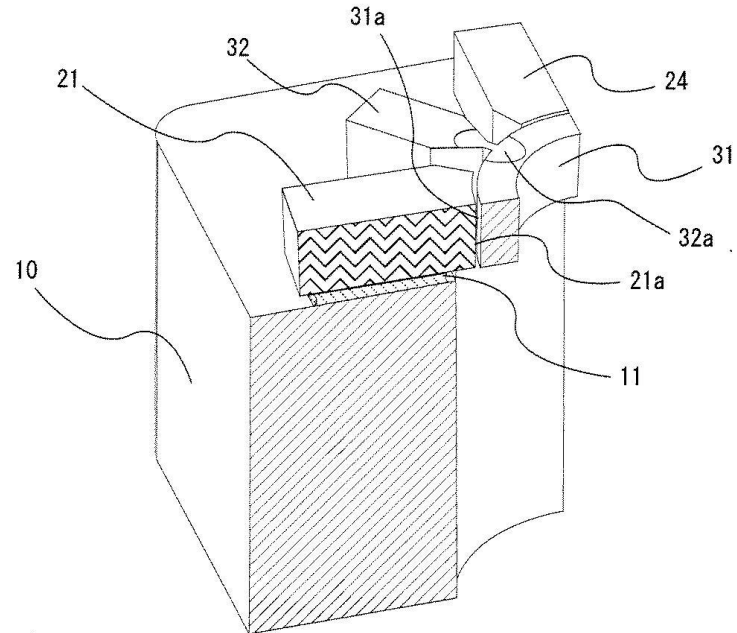
発明の内容（概要）

【課題】 回路構成の設計自由度の高いMEMS及びMEMSの製造方法を提供する。

【解決手段】 基板10と、基板10の一方の面側に設けられる第1半導体部21と、基板10の一方の面側に設けられる振動子31と、を備えるMEMSにおいて、第1半導体部21の側面側に設けられ、かつ基板表面に対して略垂直な第1面21aと、振動子31の側面側に設けられ、かつ基板表面に平行な方向において第1面21aと対向する第2面31aが設けられると共に、第2面31a側の表層部分は第1面21a側をゲート電極として電圧が印加された際にチャンネルとなることで、第1半導体部21における第1面21aを含む部分と振動子31における第2面31aを含む部分とで電界効果トランジスタが構成されることを特徴とする。



MEMSの斜視図



MEMSの一部破断斜視図